JP2046779

Title: PN JUNCTION TYPE LIGHT EMITTING DIODE USING SILICON CARBIDE SEMICONDUCTOR

Abstract:

PURPOSE:To radiate, with high efficiency, short wave length vissible rays from green to violet by making at least one of a P-type layer and an N-type layer contain transition element exhibiting tetravalence as the luminescent center. CONSTITUTION:Transition element exhibiting tetravalence is applied to the luminescent center. For example, Ti, Zr and Hf are quoted. Dosage of these transition elements is typically in a range of 10<15>-10<19>cm<-3>. The transition element to be introduced as the luminescent center is added to both of a P-type layer and an N-type layer or to either one of the layers. In the first place, an N-type SiC single crystal thin layer 3 is grown on an N-doped N-type SiC single crystal substrate 1, by using silicon melt to which nitrogen impurity is added. Next, on the n-type SiC single crystal thin layer 3, a P-type SiC single crystal thin layer 4 is grown by using silicon melt to which Al is added. When the SiC single crystal thin layer is grown, Ti is contained in both of the N-type SiC single crystal thin layer 3 and the P-type SiC single crystal thin layer 4 as the luminescent center, by adding metal titanium to silicon melt.



19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-46779

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月16日

H 01 L 33/00

A 7733-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

20発明の名称 炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光ダイオード

②特 顧 昭63-197500

②出 願 昭63(1988)8月8日

⑩発 明 者 鈴 木 彰 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

M

@発 明 者 古 川 勝 紀 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発 明 者 繁 田 光 浩 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑩発 明 者 藤 井 良 久 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

②出願人 シャープ株式会社 大阪府大阪市

個代 理 人 弁理士 山本 秀策

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

明 細 婁

1. 発明の名称

炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光ダイオード

2. 特許請求の範囲

1. 炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光ダイオードであって,

p型層および n型層の少なくとも一方に発光中心として 4 価の原子価を示す遷移元素を含む、pn接合型発光ダイオード。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光 ダイオードに関し、特に緑から紫色の短波長可視 光を発光するpn接合型発光ダイオードに関する。

(従来の技術)

発光ダイオードは、小型で、消費電力が少なく、 高輝度発光を安定に行い得る発光源であるため、 各種表示装置における表示素子として広く用いられ、また各種情報処理装置における情報記録読み 取り用の光源としても利用されている。しかし、赤から緑色の発光ダイオードは実用化されているが、青から紫色の短波長可視光を発光する発光ダイオードは実用的な性能を有する素子が開発されていない

発光ダイオードの発光色は用いる半導体材料に依存し、青色発光ダイオード用の半導体材料としては、IVーIV族化合物半導体である炭化珪素(SiC)、IIーV族化合物半導体である窒化ガリウム(GaN)、およびIIーVI族化合物半導体である硫化亜鉛(ZnS)およびセレン化亜鉛(ZnSe)に限られる。これらの半導体材料を用いて、青色発光ダイオードの研究開発が盛んに行われているが、実用に供しうる輝度と安定性とを有する素子の量産化には至っていない。

発光ダイオードの素子構造としては、pn接合型の発光ダイオードが、電子や正孔キャリアを発光領域へ高効率に注入できるため最も適している。しかしながら、上記の育色発光ダイオード用半導体材料の中で、GaN、ZnS、およびZnSeの各半導体

は、p型結晶を得ることが困難か、あるいは得られても、高抵抗であったり、極めて不安定であるため、pn接合型の発光ダイオードを作製することはできない。それゆえ、薄い絶縁層を利用したMIS構造(金属一絶縁層一半導体構造)が採用されている。このような MIS構造を有する発光ダイオードは、案子特性が不均一であったり、発光が不安定であるという欠点を有する。

これに対して、炭化珪素(SiC) は、p型結晶および n型結晶が容易に得られるため、pn接合型の発光ダイオードを作製することができる。しかも、このようなpn接合型発光ダイオードの作製に際して、液相エピタキシャル成長法(LPE法) や気相エピタキシャル成長法(CVD法) などの量産に適した方法を用いることができるという利点を有する。アルミニウム(A1)を発光中心として用いた炭化葉の報告がなされている(例えば、 M. Ikeda, T. Hayakawa, S. Yamagiwa, H. Matsunami, and T. Tanaka, Journal of Applied Physics, Vol.50,

き、pn接合面ではは保存のでははできます。 を電子と、AIアクセプタに補足をの発光に補選帯の発光に補選帯の発光に補選帯の発光には伝導の発光には伝導の発光には大きれたである。 AIアクセプタにははいる。 AIアクセプタにははいる。 を正利用のではないないが、p型発光ではいる。 でできないますが、できないのではない。 はって、発光のではないのできないが、できないには、できないが、できないにはいる。 を正子に対して、発光のの制御ながであれている。 はって、発光があることが困難の子がにはいる。 またがにないて、発光がにはいる。 を発光がにはいる。 を発光がにいる。 にいる。 を発光がにいる。 にいる。 を発光がにいる。 にいる。 にいる。

本発明は上記従来の問題を解決するものであり、 その目的とすることころは、緑から紫色の短波長 可視光を効率よく安定に発光し得る、炭化珪素半 導体を用いたpn接合型発光ダイオードを提供する ことにある。 No.12, pp. 8215-8225, 1979).

(発明が解決しようとする課題)

炭化珪素を用いた従来のpn接合型発光ダイオー ドの一例を第3図に示す。このpn接合型発光ダイ オードは、 n型SiC 単結晶基板 1 上に、 n型SiC 単結晶薄層 7 と p型SiC 単結晶薄層 8 とが順次積 層された構造を有する。また、 n型SiC 単結晶基 板1および p型SiC 単結晶薄層8の上には、 n型 SiC 用オーミック電極9および p型SiC 用オーミ ック電極10がそれぞれ形成されている。 n型SiC 単結晶薄層でにおけるキャリア発生用ドーパント としては窒素(N) ドナーが用いられ、 p型SiC 単 結晶薄層 8 におけるキャリア発生用ドーパントと してはアルミニウム(A1)アクセプタが用いられて いる。ガリウム(Ga)アクセプタやホウ素(B) アク セプタが用いられる場合もある。青色用の発光中 心として、 n型SiC 単結晶薄層 7 にAlが添加され ている.

このようなpn接合型発光ダイオードは、n型SiC 単結晶層 7 にも適量のAIアクセプタを添加してお

(課題を解決するための手段)

本発明は炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光 ダイオードであって、p型層および n型層の少な くとも一方に発光中心として 4 価の原子価を示す 遷移元素を含んでなり、そのことにより上記目的 が達成される。

本発明の炭化珪素を用いたpn接合型発光ダイオードでは、p型層および n型層のキャリア濃度を制御するアクセプタおよびドナーとは別に、発光過程を制御するための発光中心を導入している。これら発光中心は、キャリア濃度に影響を与えるようなキャリアを発生せず、かつ発光中心として電子や正孔を充分に捕捉し得るエネルギー準位を有する必要がある。

本発明に用いられる発光中心としては、4 価の原子価を示す還移元素である、例えばチタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、およびハフニウム(Hf)を挙げることができる。これらの還移元素は同時に複数の種類のものを用いてもよい。これらの還移元素の添加量は、典型的には10¹⁵~10¹⁷cm⁻³の範囲で

ある.

発光中心として導入する上記還移元素は、 p型層および n型層の両方に添加するか、あるいはいずれか一方に添加される。この場合、遷移元素は p型層および/または n型層の全体に添加しても、あるいは部分的に添加してもよい。

上記の遷移元素は、炭化珪素(SiC) 結晶中に導入された場合、原子の大きさにより、Siの格子点に入るが、SiやC と同様に 4 価の原子価を示す元素であるため、価電子の過不足が生じることなく周囲の炭素原子と共有結合を形成し得る。従って、キャリア濃度や導電性に影響を与えるようなキャリアを発生しない。

さらに、これらの遷移元素は、 d 敷が電子で完全に充たされていないため、炭化珪素の結晶中で周囲の炭素原子と共有結合を形成した場合、電子を有効に捕捉し得るエネルギー準位を有する。 このようなエネルギー準位に電子が捕捉されると、正孔が該電子のクローン引力により捕捉される。 そして、これらの捕捉された電子と正孔とが発光

4とが順次積層された構造を有する。 n型SiC 単結晶薄層 3 および p型SiC 単結晶薄層 4 には、いずれも発光中心としてTiが添加されている。

上記の n型SiC 単結晶薄層 3 および p型SiC 単結晶薄層 4 を形成する方法としては、炭化珪素単結晶を成長させるのに通常用いられる液相エピタキシャル成長法(LPE法) を用いた。該 LPE法は、例えばM. Ikeda. T. Hayakawa, S. Yamagiwa, H. Matunami, and T. Tanaka, Journal of Applied Physics, Vol.50, No.12, pp. 8215-8225 (1979)に開示されている。

まず、Nをドープした n型SiC 単結晶基板 1 上に、窒素不純物を添加した珪素溶融液を用いて、n型SiC 単結晶薄層 3 を成長させた。 n型SiC 単結晶薄層 3 の厚さは 5 μm であり、キャリア濃度は約 1 × 10¹⁸ cm⁻³であった。

次いで、 n型SiC 単結晶薄層 3 の上に、A1を添加した珪素溶融液を用いて、 p型SiC 単結晶薄層 4 を成長させた。 p型SiC 単結晶薄層 4 の厚さは 約 4 μm であり、キャリア濃度は約 1 × 10 ** cm - 3

再結合を行う。上記の発光中心を用いた場合、発 光再結合による発光波長は緑から紫色の可視光領 域となる。

本発明の炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光 ダイオードは、p型層および n型層におけるキャリア濃度の制御とは別に発光過程を制御し得る発 光中心を導入したことにより、発光効率が向上し、 高輝度発光が可能となった。しかも、発光中心と して上記の遷移金属を用いているため、従来実用 化が困難であった青から紫色の発光色が達成された。

(実施例)

以下に本発明の実施例について説明する。

<u> 実施例1</u>

本実施例では発光中心としてチタン(fi)を用いた発光ダイオードについて説明する。第1図に該発光ダイオードの断面図を示す。本実施例のpn接合型発光ダイオードは、Nをドープした n型SiC 単結晶基板1上に、Nをドープした n型SiC 単結晶薄層3と、AIをドープした p型SiC 単結晶薄層

であった。

上記のSiC 単結晶薄層を成長させる際には、珪 素溶融液に金属チタンを添加しておくことにより、 n型SiC 単結晶薄層 3 および p型SiC 単結晶薄層 4 の両方に発光中心としてTiを含有させた。

最後に、 n型SiC 単結晶基板 1 の n型SiC 単結晶薄層 3 を形成した面とは反対側の面上に、ニッケルからなる n型SiC 用オーミック電極 9 を形成し、 p型SiC 単結晶薄層 4 の上にはA1-Si 合金からなる p型SiC 用オーミック電極10を形成することにより、第 1 図に示すような発光ダイオードを得た。

 これらSiC 単結晶薄層へのチタン添加量が10¹³~10¹⁹cm⁻³の範囲である場合に発光が観測された。 チタン添加量が10¹⁹cm⁻³を越えると、SiC 薄層の 結晶性が低下して発光は見られなくなった。本実 施例のpn接合型発光ダイオードの最大発光効率は 0.5 %であり、従来の育色発光ダイオードに比べ て発光効率が1桁以上向上した。

実施例2

本実施例では発光中心としてジルコニウム(2r)を用いた発光ダイオードについて説明する。第2図に該発光ダイオードの断面図を示す。本実施例のpn接合型発光ダイオードは、ノンドーブの高抵抗SiC 単結晶基板2上に、Nをドープしたn型SiC単結晶薄層.5 と、A1をドープした p型SiC 単結晶薄層 6 とが順次積層された構造を有する。n型SiC単結晶薄層 5 および p型SiC 単結晶薄層 6 には、いずれも発光中心として2rが添加されている。

上記の n型SiC 単結晶薄層 5 および p型SiC 単結晶薄層 6 を形成する方法としては、炭化珪素単結晶を成長させるのに通常用いられる気相エピタ

キシャル成長法(CVD法)を用いた。該CVD 法は、例えば S. Nishino, H. Suhara, H. Ono, and H. Matsunami, Journal of Applied Physics, Vol. 61, No.10, pp. 4889-4893 (1987)に開示されている。炭化珪素単結晶を成長させるための原料ガスとしては、モノシラン(SiH+)ガスおよびプロパン(C2He)ガスを用いた。基板としては、ノンドープの高抵抗SiC 単結晶を用いた。

まず、上記の原料ガス以外にドーピング用の窒素 (N_z) ガスを加えて、ノンドープ高抵抗SiC 単結晶基板 2 上に、 n型SiC 単結晶薄層 5 を成長させた。 n型SiC 単結晶薄層 5 の厚さは約 5 μ α であり、キャリア濃度は約 1×10^{16} cm⁻³であった。

次いで、Nzガスに代えて、Alドーピング用のトリメチルアルミニウム(TMA) ガスを用いて、 n型SiC 単結晶薄層 5 の上に、 p型SiC 単結晶薄層 6 を成長させた。 p型SiC 単結晶薄層 6 の厚さは約 4 μm であり、キャリア濃度は約 1 × 10 ¹⁰ cm⁻³であった。上記のSiC 単結晶薄層を成長させる際には、反応管中に金属ジルコニウムを載置して加熱

することにより、 n型SiC単結晶薄層 5 およびp型 SiC 単結晶薄層 6 の両方に発光中心としてZrを含 有させた。

最後に、p型SiC 単結晶薄層 6 の一部をドライエッチングで除去し、n型SiC 単結晶薄層 5 の上にニッケルからなる n型SiC 用オーミック電極 9 を形成し、p型SiC単結晶薄層 6 の上には p型SiC 用オーミック電極10を形成することにより、第 2 図に示すような発光ダイオードを得た。

このようにして得られた炭化珪素発光ダイオードは、順バイアスの電圧を印加することにより、第2図に示すように、主としてノンドープ高抵抗SiC 単結晶基板2の下側表面から発光した。このように、本実施例の発光ダイオードでは、基板として透明なノンドープSiC 単結晶を用いているため、発光は基板側から取り出すことができる。3.5V、20mAの動作条件で、460mm 付近に発光ピーク波長を有する強い脅色の発光が得られた。上記のSiC 単結晶薄層へのジルコニウム添加量が10'2〜10'* cm-2の範囲である場合に発光が観測された。本実

施例のpn接合型発光ダイオードの最大発光効率は 0.7 %であり、従来の背色発光ダイオードに比べ て発光効率が1桁以上向上した。

(発明の効果)

本発明によれば、このように、これまで実現されていなかった脅から繁色の短波長可視光を効率よく安定に発光が得る発光ダイオードが得る表光がイオードは、例えば各種表子をである。発光がイオードを光源として用いた各種情報処理装置における情報記録のの高速化および高密度化を可能によりで製し得るため、通常の炭化珪素単結晶成長法により作製し得るため、量産化が容易である。従って、発光ダイオードの応用分野が飛躍的に拡大される。4、図面の簡単な説明

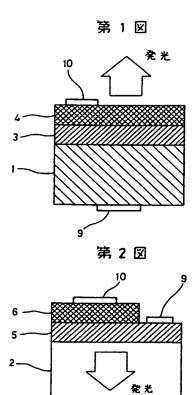
第1図は本発明の一実施例である炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光ダイオードの断面図、第2図は本発明の他の実施例である炭化珪素半導体を用いたpn接合型発光ダイオードの断面図、第3図は炭化珪素半導体を用いた従来のpn接合型発光

ダイオードの断面図である。

1 ··· Nドープ n型SiC 単結晶基板、2 ··· ノンドープ高抵抗SiC 単結晶基板、3 ··· 発光中心としてTiが添加されたNドープn型SiC 単結晶薄層、4 ··· 発光中心としてTiが添加されたAIドープ p型SiC 単結晶薄層、5 ··· 発光中心として2rが添加されたNドープn型SiC 単結晶薄層、6 ··· 発光中心としてZrが添加されたAIドープp型SiC単結晶薄層、7 ··· 発光中心としてAIが添加されたNドープn型SiC 単結晶薄層、8 ··· AIドープp型SiC単結晶薄層、9 ··· n型SiC用オーミック電極。

以 上

出願人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策



第 3 図

